03,04

Влияние химического состава кристаллов $TIIn_{1-x}Er_xS_2$ ($0 \le x \le 0.01$) на их диэлектрические характеристики и параметры локализованных состояний

© С.Н. Мустафаева¹, М.М. Асадов²

¹ Институт физики НАНА, Баку, Азербайджан ² Институт катализа и неорганической химии им. М.Ф. Нагиева НАНА, Баку, Азербайджан E-mail: solmust@gmail.com

Поступила в Редакцию 17 июня 2019 г. В окончательной редакции 3 июля 2019 г. Принята к публикации 5 июля 2019 г.

В полученных кристаллах $\text{TIIn}_{1-x}\text{Er}_x\text{S}_2$ ($0 \le x \le 0.01$) изучены частотные зависимости действительной (ε') и мнимой (ε'') составляющих комплексной диэлектрической проницаемости, тангенса угла диэлектрических потерь ($\lg \delta$) и ас-проводимости (σ_{ac}) в области частот $f = 5 \cdot 10^4 - 3.5 \cdot 10^7$ Hz. Установлено, что в $\text{TIIn}_{1-x}\text{Er}_x\text{S}_2$ имеет место релаксационная дисперсия ε' и ε'' . Изучено влияние концентрации эрбия (Er) в кристаллах $\text{TIIn}_{1-x}\text{Er}_x\text{S}_2$ на их диэлектрические коэффициенты. В области высоких частот ас-проводимость кристаллов $\text{TIIn}_{1-x}\text{Er}_x\text{S}_2$ подчинялась закономерности $\sigma_{ac} \sim f^{0.8}$, характерной для прыжкового механизма переноса заряда по локализованным вблизи уровня Ферми состояниям. Оценены параметры локализованных в запрещенной зоне $\text{TIIn}_{1-x}\text{Er}_x\text{S}_2$ состояний, а также влияние химического состава кристаллов на эти параметры.

Ключевые слова: сложные кристаллы TlIn_{1-x}Er_xS₂, частотная дисперсия, диэлектрические потери, прыжковый механизм переноса заряда, параметры локализованных состояний.

DOI: 10.21883/FTT.2019.11.48403.517

1. Введение

В последнее время тройные соединения $TIB^{III}C_2^{VI}$ ($B^{III} = In$, Ga; $C^{VI} = S$, Se, Te) полупроводниковых материалов стали важной темой для исследователей, и исследования их свойств получили значительный импульс. Их оптические, структурные и электрические свойства [1] показывают, что они обладают потенциалом для использования в производстве оптоэлектронных устройств. Соединения $TIB^{III}C_2^{VI}$ ($B^{III} = In$, Ga; $C^{VI} = S$, Se, Te) имеют различные полиморфные модификации.

Одним из представителей этого класса материалов является соединение TIInS₂, которое является слоистым полупроводником *p*-типа. TIInS₂ состоит из элементов III и VI группы периодической системы элементов Менделеева и обладает слоистой структурой. В кристалле TIInS₂ ионно-ковалентные связи происходят между атомами, тогда как слабые ван-дер-ваальсовые связи создаются между последовательными двумерными слоями, которые перпендикулярны направлению (001). Согласно [2,3] пространственная группа C_{2h}^6 характеризует кристаллическую симметрию TIInS₂, которая имеет моноклинную структуру при комнатной температуре.

Электрические и оптические свойства кристалла $TlInS_2$ исследованы и описаны соответственно в литературе [4–9]. В частности, в недавней работе [8] в слоистых монокристаллах $TlInS_2$ исследована фотопроводимость,

спектральное распределение фототока, зависимости времени жизни носителей заряда от интенсивности света, приложенного напряжения и температуры. Результаты получены в диапазоне температур 77–300 К, интенсивностей возбуждения 1000-7000 люкс, приложенного напряжения 10-70 V и при длине волны фотонов 400-570 nm. С использованием результатов измерений dc-фотопроводимости описана температурная зависимость ширины запрещенной зоны. Установлено, что процессы рекомбинации в TIInS₂ являются мономолекулярными.

В [9] сообщается о результатах фотоэлектрического релаксационного спектроскопического исследования электрически активных дефектов в кристаллической структуре $TIInS_2$: La. Показано, что существуют состояния кристалла, которые отличаются величиной фотоотклика, изменяющейся в пределах четырех порядков. Это интерпретируется на основе различия в состоянии доменной структуры кристалла. Обсуждаются особенности регистрации термоэмиссии дефектов при наличии вклада фотовольтаической составляющей реакции кристалла на возбуждение светом.

В [10] сообщается о температурной зависимости свойств генерации второй гармоники (ГВГ) в слоистом TlInS₂. А в работе [11] сообщается о поляризационных свойствах сигнала ГВГ в TlInS₂ ниже температуры сегнетоэлектрического фазового перехода. ГВГ в кристал-



Рис. 1. Рентгенограмма $TlIn_{1-x}Er_xS_2$, где x = 0.005.

лах TIInS₂ изучалась в интервале температур 77–300 K с использованием системы конфокального лазерного микроскопа. Сигнал ГВГ наблюдался в низкотемпературной сегнетоэлектрической фазе. Исследованы также поляризационные свойства сигналов ГВГ в TIInS₂ в диапазоне температур 80-180 K.

TllnS₂ обладает также широким спектром других важных физических характеристик, таких как высокая фото- и рентгеночувствительность [12–18]. В [12,13] изучена прыжковая проводимость монокристаллов TllnS₂ как на постоянном, так и на переменном токе. В [14] приведены результаты по изучению оптических свойств TllnS₂. В [15,16] приведены результаты изучения влияния γ -радиации на проводимость и диэлектрические характеристики монокристаллов TllnS₂. В [17,18] изучено влияние интеркалирования литием на электрические, фотоэлектрические и рентгендозиметрические свойства монокристаллов TllnS₂.

В процессе легирования полупроводников, как известно, физические свойства зависят в основном от того, какое положение занимает легирующая добавка в объеме кристаллической структуры полупроводника. А вопрос о путях замещения катионных позиций в низкоразмерных $\text{TIB}^{\text{III}}\text{C}_2^{\text{VI}}$ редкоземельными ионами с 4f-оболочками до конца не изучен. Поэтому детальное изучение свойств легированных 4f-ионами соединений $\text{TIB}^{\text{III}}\text{C}_2^{\text{VI}}$ остается актуальным. Кроме важных физических свойств $\text{TIB}^{\text{III}}\text{C}_2^{\text{VI}}$ обладают также набором интересных физико-химических свойств, обусловленных эффектами кристаллического поля за счет обменного взаимодействия d- и f-электронных подсистем.

Например, в [19,20] нами приведены результаты изучения электрических и диэлектрических свойств синтезированных монокристаллов $TlGa_{1-x}Er_xS_2(Se_2)$. Установлено, что частичное замещение в кристалле $TlGaS_2(Se_2)$ галлия эрбием приводит к уменьшению диэлектрической проницаемости. Показано, что катионное замещение Ga^{3+} легирующими металлами в $TlGaSe_2$ обусловлено тем, что в структуре кристалла исходные элементы находятся в Tl^{1+} , Ga^{3+} , Se^{2-} степенях окисления.

Цель данной работы — изучение электрических и диэлектрических свойств полученных $\text{Tlln}_{1-x}\text{Er}_x\text{S}_2$ (x = 0; 0.001; 0.005 и 0.01) в переменных электрических полях радиочастотного диапазона; установление характера изменения свойств кристаллов $\text{Tlln}_{1-x}\text{Er}_x\text{S}_2$ с увеличением концентрации введенного легирующего 4f-иона эрбия при изменении x в пределах 0–0.01.

2. Методическая часть

Оценка растворимости эрбия в объеме кристаллической решетки $TIInS_2$ указывает на то, что ионный радиус легирующего $Er^{3+}~(1.03~{\rm \AA})$ ближе к ионному радиусу $In^{3+}~(0.76~{\rm \AA})$, чем к ионному радиусу $TI^{1+}~(1.64~{\rm \AA})$. Т.е. в слоистом кристалле $TIInS_2$ частичное замещение индия эрбием соответствует условию образования твердого раствора замещения.

В качестве исходных компонентов использовали особо чистые химические элементы Tl (Tl 00), In (In 00), S (осч 16-5) и Er (99.99%). TlInS₂ и образцы $TlIn_{1-x}Er_xS_2$ (x = 0; 0.001; 0.005 и 0.01) синтезировали из взятых в стехиометрических соотношениях химических элементов путем непосредственного их сплавления в вакуумированных до 10^{-3} Ра кварцевых ампулах. Гомогенизацию синтезированных образцов производили в вакууме 10^{-3} Ра. Завершенность синтеза поликристаллов TIIn_{1-x}Er_xS₂, их гомогенность и индивидуальность контролировали методами ДТА и РФА. РФА порошковых образцов TIIn_{1-x}Er_xS₂ проводили на дифрактометре D8-ADVANCE в режиме $0.5^{\circ} < 2\theta < 80^{\circ}$ (Cu_{K α}-излучение; $\lambda = 1.5418$ Å) при 40 kV и 40 mA.

Кристаллы TIIn_{1-x}Er_xS₂ (x = 0; 0.001; 0.005 и 0.01) со слоистой структурой легко скалывались по базисной плоскости. Провели РФА порошковых образцов кристаллов TIIn_{1-x}Er_xS₂. Установлено, что введенное количество Er (x = 0.001; 0.005 и 0.01) слабо влияет на параметры кристаллической решетки матрицы TIInS₂. Полученные кристаллографические данные для TIIn_{1-x}Er_xS₂ согласуются с литературными [21] для TIInS₂, (a = 10.90 Å, b = 10.94 Å, c = 15.18 Å, $\beta = 100.21^{\circ}$).

В качестве примера на рис. 1 приведена типичная рентгенограмма образца на основе TIInS₂, содержащего 0.005 мол. доли эрбия (a = 10.9116, b = 10.9247, c = 15.1649 Å, $\beta = 100.3227^{\circ}$, V = 1778.49 Å³, d = 5.670 g/cm³, моноклинная сингония, пространственная группа A2/a).

Образцы $TlIn_{1-x}Er_xS_2$ для электрических измерений готовили в виде плоских конденсаторов. В качестве электродов использовали серебряную пасту. Толщина кристаллических образцов из $TlIn_{1-x}Er_xS_2$ составляла от 200 до 1000 μ m.

Диэлектрические коэффициенты образцов ТIIn_{1-x}Er_xS₂ измеряли резонансным методом с помощью куметра TESLA BM 560. Диапазон частот переменного электрического поля составлял $f = 5 \cdot 10^4 - 3.5 \cdot 10^7$ Hz.

В процессе электрических измерений образцы $TlIn_{1-x}Er_xS_2$ помещались в экранированную камеру. Все измерения проведены при 300 К. Амплитуда приложенного к образцам переменного электрического поля соответствовала омической области вольтамперной характеристики. Точность определения резонансных значений емкости и добротности ($Q = 1/tg \delta$) измерительного контура ограничена ошибками, связанными со степенью разрешения отсчетов по приборам. Градуировка конденсатора имела точность ± 0.1 pF. Воспроизводимость положения резонанса составляла по емкости ± 0.2 pF, а по добротности $\pm 1.0-1.5$ деления шкалы. При этом наибольшие отклонения от средних значений составляли 3-4% для ε' и 7% для $tg \delta$ [22].

3. Результаты и их обсуждение

На рис. 2 представлены частотные зависимости действительной составляющей комплексной диэлектрической проницаемости ε' кристаллов TIIn_{1-x}Er_xS₂ (x = 0;



Рис. 2. Частотная дисперсия действительной составляющей комплексной диэлектрической проницаемости кристаллов $TIIn_{1-x}Er_xS_2$: x = 0 (1); 0.001 (2); 0.005 (3) и 0.01 (4). T = 300 K.



Рис. 3. Частотные зависимости мнимой составляющей комплексной диэлектрической проницаемости кристаллов $TlIn_{1-x}Er_xS_2$: x = 0 (1); 0.001 (2); 0.005 (3) и 0.01 (4). T = 300 K.

0.001; 0.005; 0.01). Как следует из этого рисунка в TlInS₂ (кривая *I*) имеет место незначительная частотная дисперсия ε' . В TlIn_{1-x}Er_xS₂ (x = 0.001; 0.005; 0.01) с увеличением частоты от 50 кHz до 35 MHz значение ε' уменышалось почти в 1.2–1.6 раз (кривые 2–4). Спад ε' наблюдался при сравнительно низких частотах ($5 \cdot 10^4 - 6 \cdot 10^6$ Hz). В диапазоне частот

 $6 \cdot 10^6 - 3.5 \cdot 10^7$ Hz величина ε' практически не зависела от частоты.

На рис. 3 приведены частотные зависимости мнимой составляющей комплексной диэлектрической проницаемости (ε'') Tlln_{1-x}Er_xS₂. В отличие от величины ε' , значение ε'' для составов x = 0; 0.001; 0.005; 0.01 проявляло сильную частотную дисперсию. В "чистом" кристалле TllnS₂ величина ε'' с увеличением частоты вплоть до 35 MHz уменьшалась в 4 раза, а в Tlln_{1-x}Er_xS₂ (x = 0.001; 0.005 и 0.01) значение ε'' уменьшалась с частотой в 8–12 раз.

Важной характеристикой материала является частотная зависимость диэлектрических потерь, которая определяется не только структурой материала, но и наличием и составом примесей. В диэлектриках и сегнетоэлектриках диэлектрические потери обычно высоки в области мегагерцовых частот, что связывается с установлением доменной поляризации.

Экспериментально полученная частотная зависимость тангенса угла диэлектрических потерь (tg $\delta = \varepsilon''/\varepsilon'$) в TlIn_{1-x}Er_xS₂ во всей изученной области частот имела спадающий характер. Такой вид частотной зависимости в материалах соответствует механизму потерь на электропроводность [23].

Таким образом, приведенные на рис. 2 и 3 результаты отражают частотные зависимости диэлектрических коэффициентов $TlIn_{1-x}Er_xS_2$. Установили также зависимости этих коэффициентов для $TlIn_{1-x}Er_xS_2$ от концентрации введенного эрбия.

На рис. 4 показаны построенные нами концентрационные зависимости для ε' (кривая *I*) и ε'' (кривая*2*). Обе зависимости приведены для случая, когда частота переменного электрического поля составляла $f = 5 \cdot 10^4$ Hz. При более высоких частотах указанные зависимости ослабевали. Как видно из рис. 4 по мере возрастания



Рис. 4. Зависимости действительной (кривая I) и мнимой (кривая 2) составляющих комплексной диэлектрической проницаемости при $f = 5 \cdot 10^4$ Hz от состава кристаллов TlIn_{1-x}Er_xS₂.



Рис. 5. Зависимости проводимости на постоянном (кривая I) и переменном (кривая 2) токе при $f = 5 \cdot 10^4$ Hz от состава кристаллов TIIn_{1-x} Er_xS₂.

концентрации эрбия в кристаллах $\text{TIIn}_{1-x}\text{Er}_x\text{S}_2$ значения ε' и ε'' увеличивались. Так, значение ε' увеличивалось на порядок, а ε'' — в 60 раз.

Нами изучена также проводимость кристаллов TlIn_{1-x}Er_xS₂ в постоянном (dc-проводимость) и переменном (ас-проводимость) электрических полях. На рис. 5 приведены зависимости σ_{dc} (кривая 1) и σ_{ac} (кривая 2) при $f = 5 \cdot 10^4$ Hz от состава кристаллов TlIn_{1-x}Er_xS₂. Установлено, что с повышением концентрации эрбия в TlIn_{1-x}Er_xS₂ проводимость образцов увеличивалась в обоих случаях, а точнее: σ_{dc} — в 80 раз, σ_{ac} — в 60 раз. Проводимость кристаллов TlIn_{1-x}Er_xS₂ на переменном токе более чем на два порядка превышала проводимость на постоянном токе.

На рис. 6 представлены частотные зависимости проводимости кристаллов TIIn_{1-x} Er_xS₂ различного состава. В TIInS₂ (кривая *I*) в частотной области $5 \cdot 10^4 - 10^7$ Hz имел место участок $\sigma_{\rm ac} \sim f^{0.8}$, а при $f > 10^7$ Hz наблюдалась суперлинейная зависимость $\sigma_{\rm ac} \sim f^{1.3}$.

Характерной особенностью указанных зависимостей $\sigma_{\rm ac}(f)$ для ${\rm Tlln}_{1-x}{\rm Er}_x{\rm S}_2$ (x = 0; 0.001; 0.005 и 0.01) является то, что при сравнительно низких частотах $\sigma_{\rm ac} \sim f^{0.5}$, а при высоких частотах $\sigma_{\rm ac} \sim f^{0.8}$. Зависимость $\sigma_{\rm ac} \sim f^{0.8}$ характерна для механизма прыжковой проводимости по локализованным состояниям вблизи уровня Ферми [24,25]. Граничная частота (f_b.), начиная с которой проводимость кристаллов ${\rm Tlln}_{1-x}{\rm Er}_x{\rm S}_2$ становится прыжковой, линейно смещается в сторону более высоких частот по мере возрастания концентрации эрбия в кристаллах (рис. 7, кривая 2).

Полученные нами зависимости $\sigma_{\rm ac} \sim f^{0.8}$ в TlIn_{1-x}Er_xS₂ свидетельствуют о прыжковом механизме переноса заряда по состояниям, локализованным в



Рис. 6. Частотно-зависимая ас-проводимость кристаллов $TlIn_{1-x}Er_xS_2$: x = 0 (1); 0.001 (2); 0.005 (3) и 0.01 (4). T = 300 K.



Рис. 7. Зависимости плотности состояний вблизи уровня Ферми (кривая I) и граничной частоты начала прыжковой проводимости (кривая 2) от состава кристаллов TIIn_{1-x}Er_xS₂.

окрестности уровня Ферми [24]:

$$\sigma_{\rm ac}(f) = \frac{\pi^3}{96} e^2 k T N_{\rm F}^2 a^5 f \left[\ln\left(\frac{\nu_{\rm ph}}{f}\right) \right]^4, \qquad (1)$$

где e — заряд электрона; k — постоянная Больцмана; $N_{\rm F}$ — плотность состояний вблизи уровня Ферми; $a = 1/\alpha$ — радиус локализации; α — постоянная спада

волновой функции локализованного носителя заряда $\psi \sim \bar{e}^{\, \alpha r}$; $v_{\rm ph}$ — фононная частота.

Согласно формуле (1) ас-проводимость зависит от частоты как $f \left[\ln(\nu_{\rm ph}/f) \right]^4$, т.е. при $f \gg \nu_{\rm ph}$ величина $\sigma_{\rm ac}$ пропорциональна $f^{0.8}$.

Используя формулу (1) по экспериментально найденным значениям $\sigma_{ac}(f)$ вычислили плотность состояний на уровне Ферми. Вычисленные значения N_F для Tlln_{1-x}Er_xS₂ различного состава приведены на рис. 7 (кривая *I*). При вычислениях N_F значение $v_{\rm ph}$ взято равным 10¹² Hz, а за радиус локализации взято значение a = 14 Å, как для TllnS₂ [13].

По теории прыжковой проводимости на переменном токе среднее расстояние прыжков (*R*) определяется по следующей формуле

$$R = \frac{1}{2\alpha} \ln\left(\frac{\nu_{\rm ph}}{f}\right). \tag{2}$$

Вычисленные по формуле (2) значения R для кристаллов TIIn_{1-x}Er_xS₂ составляли 77-86 Å. Эти значения R в 5.5-6 раз превышают среднее расстояние между центрами локализации носителей заряда в TIIn_{1-x}Er_xS₂. Используя значения R по формуле

$$\tau^{-1} = \nu_{\rm ph} \exp(-2\alpha R) \tag{3}$$

определили среднее время прыжков в $TIIn_{1-x}Er_xS_2$: $\tau = 5.5 \cdot 10^{-8} - 2 \cdot 10^{-7}$ s.

По формуле [24]

$$\Delta E = 3/2\pi R^3 \cdot N_{\rm F} \tag{4}$$

в $TlIn_{1-x}Er_xS_2$ оценили энергетический разброс локализованных вблизи уровня Ферми состояний $\Delta E = 32-140$ meV. А по формуле:

$$N_{\rm t} = N_{\rm F} \cdot \Delta E \tag{5}$$

определили концентрацию глубоких ловушек в TIIn_{1-x}Er_xS₂, ответственных за ас-проводимость $N_t = 7 \cdot 10^{17} - 10^{18}$ cm⁻³. Установлено, что с увеличением концентрации эрбия в TIIn_{1-x}Er_xS₂ плотность локализованных вблизи уровня Ферми состояний увеличивается с $5.2 \cdot 10^{18}$ до $3.3 \cdot 10^{19}$ eV⁻¹ · cm⁻³. Это происходит, по-видимому, за счет сужения энергетической полосы локализованных состояний. При этом концентрация носителей заряда на глубоких уровнях (N_t) в TIIn_{1-x}Er_xS₂ увеличивалась незначительно.

4. Заключение

Методом прямого синтеза из исходных химических элементов в вакууме получены слоистые кристаллы $TIIn_{1-x}Er_xS_2$ (x = 0; 0.001; 0.005 и 0.01). Изучение частотной дисперсии диэлектрических коэффициентов при $f = 5 \cdot 10^4 - 3.5 \cdot 10^7$ Hz и проводимости кристаллов $TIIn_{1-x}Er_xS_2$ позволили установить релакса-

ционный характер дисперсии действительной и мнимой составляющих комплексной диэлектрической проницаемости. Также установлены природа диэлектрических потерь и прыжковый механизм переноса заряда. Оценили параметры локализованных состояний, такие как плотность состояний вблизи уровня Ферми $(N_{\rm F} = 5.2 \cdot 10^{18} - 3.3 \cdot 10^{19} \, {\rm eV^{-1} \cdot cm^{-3}})$ и их энергетический разброс ($\Delta E = 32 - 140 \text{ meV}$), среднее время $(\tau = 5.5 \cdot 10^{-8} - 2 \cdot 10^{-7} \text{ s})$ и расстояние (R = 77 - 86 Å)прыжков, а также концентрацию глубоких ловушек $(N_{\rm t} = 7 \cdot 10^{17} - 10^{18} \,{\rm cm}^{-3})$. Установлено, что по мере увеличения концентрации эрбия в кристаллах $TIIn_{1-x}Er_xS_2$ действительная и мнимая составляющие их комплексной диэлектрической проницаемости, тангенс угла диэлектрических потерь, dc- и ас-проводимость увеличивались. С повышением концентрации введенного эрбия в TlIn_{1-x}Er_xS₂ граничная частота, начиная с которой в изученных образцах кристаллов наблюдалась прыжковая проводимость, линейно смещалась в сторону высоких частот. Введение эрбия в TlIn_{1-x}Er_xS₂ приводило к уменьшению среднего расстояния и времени прыжков, а также к увеличению плотности состояний, локализованных вблизи уровня Ферми.

Финансирование работы

Работа выполнена при поддержке Фонда развития науки при Президенте Азербайджанской Республики (гранты № Е-F-BGM-3-BRFTF-2+/2017-15/05/1-М-13 и № Е-F-BGM-4-RFTF-1/2017-21/05/1-М-07) и SOCAR.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- Y. Shim, W. Okada, K. Wakita, N. Mamedov. J. Appl. Phys. 102, 1 (2007).
- [2] T.D. Ibragimov, I.I. Aslanov. Solid State Commun. **123**, 339 (2002).
- [3] O.Z. Alekperov, G.B. Ibragimov, I.A. Axundov, A.I. Nadjafov, A.R. Fakix. Phys. Status Solidi C 6, 981 (2009).
- [4] M.M. El-Nahass, S.B. Youssef, H.A.M. Ali, A. Hassan. Eur. Phys. J. Appl. Phys. 55, 1 (2011).
- [5] O.O. Gomonnai, R.R. Rosul, P.P. Guranich, A.G. Slivka, I.Yu. Roman, M.Yu. Rigan. High Press. Res. 32, 39 (2012).
- [6] M. Isik, S. Delice, N.M. Gasanly. Acta Phys. Pol. A 126, 1299 (2014).
- [7] S. Delice, N.M. Gasanly. Physica B 499, 44 (2016).
- [8] I.M. Ashraf, A. Salem, M.J.A.L. Salah. Euro. J. Appl. Eng. Sci. Res. 6, 2, 34 (2018).
- [9] А.П. Одринский, М.-Н.Yu. Seyidov, R.A. Suleymanov, Т.Г. Мамедов, В.Б. Алиева. ФТТ 58, 4, 696 (2016)
- [10] Y. Araki, R. Asaba, K. Wakita, Y.G. Shim, K. Mimura, N. Mamedov. Phys. Status Solidi C 10, 1136 (2013).
- [11] K. Wakita, M. Hagiwara, R. Paucar, Y. Shim, K. Mimura, N. Mamedov. J. Phys. Conf. Ser. 619 (2015). 012006. doi:10.1088/1742-6596/619/1/012006

- [12] С.Н. Мустафаева, В.А. Алиев, М.М. Асадов. ФТТ 40, 4, 612 (1998).
- [13] С.Н. Мустафаева, М.М. Асадов, В.А. Рамазанзаде. ФТТ 38, 1, 14 (1996).
- [14] А.В. Короткий, А.У. Шелег, В.В. Шевцова, А.В. Мудрый, С.Н. Мустафаева. Журн. прикл. спектроскопии 79, 3, 418 (2012).
- [15] С.Н. Мустафаева, М.М. Асадов, А.А. Исмайлов. ФТТ 51, 11, 2140 (2009).
- [16] А.У. Шелег, В.Г. Гуртовой, В.В. Шевцова, С.Н. Мустафаева. ФТТ 54, 9, 1754 (2012).
- [17] S.N. Mustafaeva, V.A. Ramazanzade, M.M. Asadov. Mater. Chem. Phys. 40, 2, 142 (1995).
- [18] С.Н. Мустафаева, М.М. Асадов, В.А. Рамазанзаде. Неорган. материалы **31**, *3*, 318 (1995).
- [19] С.Н. Мустафаева, М.М. Асадов, Э.М. Керимова, Н.З. Гасанов. Неорган. материалы 49, 12, 1271 (2013).
- [20] С.Н. Мустафаева, М.М. Асадов, Э.М. Керимова. ФТТ 55, 12, 2346 (2013).
- [21] А.У. Шелег, В.В. Шевцова, В.Г. Гуртовой, С.Н. Мустафаева. Поверхность. Рентг., синхр. нейтр. исслед. **11**, 39 (2013).
- [22] С.Н. Мустафаева. Журн. радиоэлектроники. 5, 1 (2008).
- [23] В.В. Пасынков, В.С. Сорокин. Материалы электронной техники. Высш. шк., М. (1986). 368 с.
- [24] Н. Мотт, Э. Дэвис. Электронные процессы в некристаллических веществах. Мир, М. (1974). 472 с.
- [25] Ю.И. Равич, С.А. Немов. ФТП 36, 1, 3 (2002).

Редактор Т.Н. Василевская